

Сведения о ведущей организации

по диссертации Красноухова Владислава Сергеевича
на тему: «Кинетика и механизмы реакций $\text{CH}+\text{SiH}_4/\text{GeH}_4$, $\text{C}_7\text{H}_7+\text{C}_3\text{H}_3/\text{C}_7\text{H}_7$, $\text{C}_5\text{H}_5+\text{CH}_3/\text{C}_9\text{H}_7$ в экстремальных условиях», представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.17 «Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества»

1.	Полное наименование организации	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
2.	Сокращенное наименование организации	Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, МГУ имени М.В.Ломоносова, Московский университет или МГУ
3.	Ведомственная принадлежность	Правительство Российской Федерации
4.	Место нахождения	г. Москва, Россия
5.	Почтовый адрес организации с указанием индекса	119991, Ленинские горы, дом 1
6.	Телефон с указанием кода города	+7(495)9391000
7.	Адрес электронной почты	info@rector.msu.ru
8.	Адрес официального сайта в сети «Интернет»	http://www.msu.ru/
9.	Руководитель организации	Садовничий Виктор Антонович
10.	Уполномоченный	Палов Александр Петрович
11.	Должность	Ведущий научный сотрудник «Лаборатории физики плазмы и физических основ микро-технологии», отдел микроэлектроники Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д.В. Скобельцына МГУ имени М.В. Ломоносова
12.	Ученая степень	Кандидат физико-математических наук
13.	Ученое звание	—
14.	Список основных публикаций работников структурного подразделения, составляющего	1. Палов, А. П. Упругое рассеяние атома рутения на атомах Si и O в диапазоне относительных кинетических энергий 2-200 eV / А. П. Палов // Письма в Журнал технической физики. – 2023. – Т. 49, № 9. – С. 29-31. 2. Voronina, E. N. Helium electron beam rf plasma for low-k surface functionalization / E. N Voronina, A. A. Sycheva, A. A

<p>отзыв, по тематике диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)</p>	<p>Solovykh, O. V. Proshina, T. V. Rakhimova, A. P. Palov, A. T. Rakhimov //Journal of Vacuum Science & Technology B, Nanotechnology and Microelectronics: Materials, Processing, Measurement, and Phenomena. – 2022. – Т. 40. – №. 6. – С. 062203.</p> <p>3. Zotovich, A. I. Modification of Porous Ultralow-k Film by Vacuum Ultraviolet Emission / A. I. Zotovich, S. M. Zyryanov, A. P. Palov [et al.] //ACS Applied Electronic Materials. – 2022. – Т. 4. – №. 6. – С. 2760-2776.</p> <p>4. Meng, Q. Y. Hafnium oxide layer-enhanced single-walled carbon nanotube field-effect transistor-based sensing platform / Q. Y. Meng, S. Wei, Z. Xu, A.P. Palov [et al.] // Analytica Chimica Acta. – 2021. – Vol. 1147. – P. 99-107.</p> <p>5. Palov, A. P. Non-self-sustained electron beam RF-generated plasma in application for functional surface pretreatment / A. P. Palov, O. V. Proshina, T. V. Rakhimova [et al.] // Plasma Processes and Polymers. – 2021. – Т. 18. – №. 7. – С. 2100007.</p> <p>6. Palov, A. P. VPA: Computer program for the computation of the phase shift in atom–atom potential scattering using the Variable Phase Approach / A. P. Palov, G. G. Balint-Kurti //Computer Physics Communications. – 2021. – Т. 263. – С. 107895.</p> <p>7. Liu, C. Properties of organosilicate low-k films with 1,3- A nd 1,3,5-benzene bridges between Si atoms / C. Liu, C. Lv, X. Wang, A. P. Palov [et al.] // Japanese Journal of Applied Physics. – 2020. – Vol. 59, No. SL. – P. SLLG01.</p> <p>8. Palov, A. P. Dependence of dielectric constant of hydrocarbon bridged low-k films on porosity / A. P. Palov, M. R. Baklanov, S. Wei // Journal of Vacuum Science & Technology B, Nanotechnology and Microelectronics: Materials, Processing, Measurement, and Phenomena. – 2019. – Vol. 37, No. 1. – P. 010601.</p> <p>алов, А. П. Упругое рассеяние атомных пар Мо-Мо, Мо-S и S-S в диапазоне относительных кинетических энергий 2-200 eV / А. П. Палов // Письма в Журнал технической физики. – 2018. – Т. 44, № 10. – С. 68-75.</p> <p>10. Palov, A. P. Etching low- k films by F atoms: Inside view / A. P. Palov, T. V. Rakhimova, Y. A. Mankelevich, E. N. Voronina // Journal of Vacuum Science and Technology A. – 2018. – Vol. 36, No. 2. – P. 02C103.</p> <p>11. Palov, A. P. Sputtering of Si by Ar: A binary collision approach based on quantum-mechanical cross sections / A. P. Palov, T. V. Rakhimova, G. G. Balint-Kurti, E. N. Voronina // Journal of Vacuum Science and Technology A. – 2018. – Vol. 36, No. 4. – P. 041303.</p>
--	--

Проректор Московского государственного
 Университета имени М.В. Ломоносова
 профессор
 М.П.



А.А. Федянин

«05» июля 2023 г.